

## ディンプルグラインダー Model 656

製造元	Gatan, Inc. (米国)
仕様	試料研磨ホイール回転速度： 0～600 rpm 連続可変 試料研磨加重： 0～40 g 連続可変 試料台回転速度： 10 rpm
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・1 階 118 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko</a>
注意事項等	
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 鹿住健司 075-753-5474 <a href="mailto:kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp">kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp</a>
キーワード	ディンプリング、試料作製、TEM
機器コード	0000103013
自由記入欄	イオンミリング法による TEM (透過電子顕微鏡) 試料作製では、イオンミリングの前の工程において本装置により試料に研磨で半球状のくぼみを作り、縁に厚みを残して強度を保ちつつ試料中央を 5～20 $\mu\text{m}$ くらいまで薄くする。

